

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE (MEB) ET MICROANALYSE (EDS-X ou EDX)

REF. FO MICR MEB - 2 jours (14 heures)

OBJECTIFS : Acquérir les éléments de base de l'emploi d'un microscope électronique à balayage (MEB) dans l'analyse morphologique et chimique des échantillons solides.

Sessions cette
année :

[Inter à la carte](#)

Public :
Techniciens,
ingénieurs

Prix et dates :
Nous consulter

PROGRAMME

Partie théorique

- * Interactions faisceau électronique – matière
- * Les éléments du microscope électronique à balayage
- * L'émission électronique, la formation du faisceau d'électrons
- * Les différents détecteurs d'électrons et de photons
- * Constitution d'une image électronique
- * Microanalyse EDS-X ou EDX : analyse qualitative & quantitative, calculs, limites
- * L'imagerie élémentaire (Cartographie X)

Travaux Dirigés

- * Simulations de spectres et des trajectoires électroniques

Partie pratique

- * Découverte commentée du microscope électronique à balayage : canon, détecteurs, utilisation
- Pratique du fonctionnement du microscope électronique à balayage
- * Imagerie en électrons secondaires et rétrodiffusés
- * Recherche et caractérisation de phases ; appareillage, spectres, analyse qualitative
- * Analyses semi-quantitatives et quantitatives
- * Analyses quantitatives
- * Cartographies élémentaires et spectrales
- * Traitement des données

Problèmes relatifs aux études de cas des stagiaires

ATOMER

Formation Continue - N° d'organisme de formation : 11 95 04 386 95

Tél : [+33 \(0\)6 52 34 17 63](tel:+330652341763) / 09 63 21 44 25 / 01 39 84 15 87 - E-mail : contact@atomer.fr

13, rue de la Coque F-95410 GROSLAY